PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-120458

(43)Date of publication of application: 23.04.2002

(51)Int.CL

B41M 5/26 G11B 7/24

(21)Application number: 2000-313994

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

13.10.2000

(72)Inventor: SHIBAKUCHI TAKASHI

HARIGAI MASATO FUJII TOSHISHIGE KAGEYAMA YOSHIYUKI

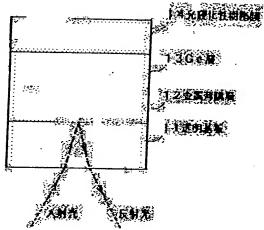
ONAKI NOBUAKI

(54) WRITE ONCE READ MANY OPTICAL RECORDING MEDIUM

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a so-called High

(57)Abstract:

to Low write once read many optical recording medium wherein the reflectance after recording reduces, and also, provide a write once read many optical recording medium of a high reflectance and a high sensitivity by a layer constitution of a less number of layers. SOLUTION: On a transparent base plate 11 made of a polycarbonate resin, an Al-Ti alloy layer and a Ge layer 13 on the top of the Al-Ti alloy layer are formed into films by a spattering method in this order. In this case, for the Al-Ti alloy layer, the Ti content of a metal foil layer 12 is 1.0 wt. %. Thus, a recording layer comprising the two layers is formed, and a protective layer comprising a photo-curing resin film (ultraviolet ray curing resin) 14 is spin-coated on the recording layer to form this optical recording medium. Then, the reflectance of an unrecorded section is made higher than the reflectance of a recording marked section, and recording/reproduction is performed from the base plate



side. Thus, a High to Low recording can be realized, and a ROM interchangeability becomes possible.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-120458 (P2002-120458A)

(43)公開日 平成14年4月23日(2002.4.23)

(51) lnt.Cl.7		識別記号	FΙ		5	i-73-1*(多考)
B41M	5/26		G11B	7/24	511	2H111
G11B	7/24	5 1 1			5 2 2 A	5 D O 2 9
		5 2 2			5 2 2 D	
			B41M	5/26	x	
			李本語 句	±28+0	ませばの事 E へ	т <i>(</i> Дев)

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

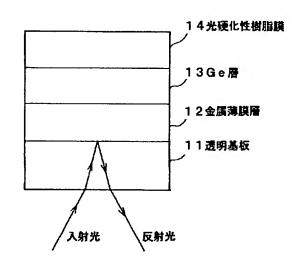
(21)出願番号	特願2000-313994(P2000-313994)	(71)出願人	000006747
			株式会社リコー
(22)出顧日	平成12年10月13日(2000.10.13)		東京都大田区中馬込1丁目3番6号
		(72)発明者	芝口 孝
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
			会社リコー内
		(72)発明者	針谷 眞人
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
			会社リコー内
		(72)発明者	藤井 俊茂
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
			会社リコー内
	<u> </u>		
•			最終質に続く
Ť.		(72)発明者	会社リコー内 針谷 成人 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 を 会社リコー内 藤井 俊茂 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 を 会社リコー内

(54) 【発明の名称】 追記型光記録媒体

(57)【要約】

【課題】 第1の目的は、記録後の反射率が低下するいわゆるHigh toLowの追記型光記録媒体を提供することであり、第2の目的は、層数の少ない層構成で高反射率・高感度の追記型光記録媒体を提供することである。

【解決手段】 ボリカーボネート樹脂からなる透明基板 11上に、A1-Ti合金層(金属薄膜層12:Ti含有量1.0wt%)と、その上のGe層13とを順次スパッタリング法で成膜することにより、これら2層からなる記録層を形成し、この記録層上に光硬化性樹脂膜(紫外線硬化樹脂)14からなる保護層をスピンコートして光記録媒体とした。未記録部の反射率を記録マーク部の反射率よりも高くし、基板側から記録・再生を行うことでHigh to Lowの記録を実現することができ、これによりROM互換が可能となった。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に金属もしくは半金属、またはこ れらの合金からなる第1層と、GeまたはGe合金から なる第2層とで形成した記録層を有することを特徴とす る追記型光記録媒体。

【請求項2】 基板上に第1層と、その上の第2層とで 形成した記録層を有し、かつ、未記録部の反射率が記録 マーク部の反射率よりも高いことを特徴とする請求項1 に記載の追記型光記録媒体。

【請求項3】 第2層の膜厚が10mm以上、70mm 10 以下であることを特徴とする請求項1または2に記載の 追記型光記録媒体。

【請求項4】 第1層がAu, Ag, Cuまたは、これ らを主成分とする合金からなり、その膜厚が20nm以 下であることを特徴とする請求項2または3に記載の追 記型光記録媒体。

【請求項5】 第1層がA1またはA1を主成分とする 合金からなり、その膜厚が15 n m以下であることを特 徴とする請求項2または3に記載の追記型光記録媒体。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光記録媒体にレー ザー光を集光照射し、記録層を形成する記録材料に変化 を生じさせて情報の記録・再生を行う追記型の光記録媒 体に関する。

[0002]

【従来の技術】特開平6-171236号公報に開示さ れた光記録媒体はGe層と、Al層またはAuとの2層 を記録層とするものである。すなわちこの光記録媒体 は、レーザー光を照射することによりA1層またはAu 30 層と、Ge層との間にAlまたはAuと、Geの相互拡 散を起こさせ、これによりAlまたはAuと、Geの偏 析が生じて、光学定数の変化が起こることを利用するも のである。

【0003】現在、記録可能なCDとして、有機物質で ある色素を記録材料に用いたものが市販されている。し かし、この記録材料は光による劣化を起こしやすいう え、記録波長の許容度が極度に狭く、また再生光の波長 によっては、反射率の変化が大きいという問題があっ た。

【0004】一方、無機材料を記録材料として用いる場 合は、高反射率を得るために金属を記録材料として用い る必要があるが、金属材料は融点が高いため、記録感度 が低いという欠点がある。現在知られている光ディスク を分類すると、オーディオコンパクトディスクに代表さ れる再生専用型と、一回記録が可能な追記型と、光磁気 効果及び相変化を利用した書き換え可能型とがある。

【0005】一回記録型の記録材料である無機材料を用 いた光記録媒体としては、Te系を代表とした穴明け型 録材料はTeC,TeSe等であり、また相変化型はT eO,が典型例である。熱拡散型ではAlまたはAu と、Geとが相互に熱拡散し、その結果光学定数が変化 する。

【0006】一方、有機材料としてはポリメチン系、環 状アザアヌレン系等の色素が利用される。しかし、これ らの有機材料は耐光性が充分でない。また、無機材料の 穴明け型に用いられるTe は耐湿性に問題があり、相変 化型であるTeO、型の記録層は反射率の点で従来のC Dと互換性がなく、AlまたはAuと、Geとの熱拡散 型は、特開平6-171236号公報に詳述されている ように、記録後の反射率が高くなる、いわゆるLow to High (ロウ→ハイ記録) の光記録媒体である ため、ROMとの互換性がないのが問題である。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来技術の 上記問題点に鑑みなされたもので、第1の目的は、一回 記録が可能な追記型光記録媒体に関し、上記熱拡散型を 利用した場合の問題点を解決し、記録後の反射率が低下 20 する、いわゆるHigh to Lowの追記型光記録 媒体を提供することにある。本発明の第2の目的は、層 数の少ない層構成で髙反射率・髙感度の追記型光記録媒 体を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の追記型 光記録媒体は、基板上に金属もしくは半金属、またはと れらの合金からなる第1層と、GeまたはGe合金から なる第2層とで形成した記録層を有することを特徴とす る。

【0009】請求項2に記載の追記型光記録媒体は、請 求項1において基板上に第1層と、その上の第2層とで 形成した記録層を有し、かつ、未記録部の反射率が記録 マーク部の反射率よりも高いことを特徴とする。

【0010】請求項3に記載の追記型光記録媒体は、請 求項1または2において、第2層の膜厚が10nm以 上、70 n m以下であることを特徴とする。

【0011】請求項4に記載の追記型光記録媒体は、請 求項2または3において、第1層がAu.Ag.Cuま たは、これらを主成分とする合金からなり、その膜厚が 40 20 nm以下であることを特徴とする。

【0012】請求項5に記載の追記型光記録媒体は、請 求項2または3において、第1層がA1またはA1を主 成分とする合金であり、その膜厚が15nm以下である ことを特徴とする。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を、図 面を参照しながら説明する。図1は、本発明の追記型光 記録媒体の構成を示した断面図である。この光記録媒体 は、透明基板11上に第1層としての金属薄膜層(金属 と、相変化型及び熱拡散型のものがある。穴明け型の記 50 層)12および、第2層としてのGe層13を、スパッ

タリングにより順次形成した構成となっている。Ge層 13上には保護用として、光硬化性樹脂膜14がスピン コートされている。

【0014】透明基板11としてはアクリル系や、ポリ カーボネート (PC) 等のプラスチック基板が使用され る。金属薄12の材料としてはA1, Ti, Au, A g、Cu、Sn、Ni、Crまたは、これらの合金が用 いられる。なお、この金属層に替えて、B、Si、S b, Se, Te等の半金属あるいは、これらと上記金属 との合金からなる層を形成することもできる。

【0015】 ととで、上記光記録媒体の記録メカニズム について概述する。レーザー光の照射により金属層12 とGe層13との間に、(金属層12を形成する)金属 元素たとえばAIと、Geとの相互拡散を起こさせる。 これによりA1とGeの偏析が生じて光学定数の変化が 起とるととを利用するものである。

【0016】さらに具体的に説明する。レーザー光の照 射によりGe層上のスポット部の温度が上昇するとGe 層とA1層の、GeとA1が相互に熱拡散し、スポット 部が記録前のAI層部分に比較してGeリッチになる。 Ge及びAlの膜厚によっては、このスポット部がAl からGeのみになる場合がある。これは、Alが蒸発消 失しているためではなく、拡散によるものであること が、オージェ電子分光法で確認されている。したがって 反射率は減少することになる。上記図1の構成では、G e層の替えてGe合金層を用いることもできる。この場 合にも、上と同様に相互拡散が生じて反射率が減少す

[0017]

٠.٠٠

【実施例】実施例1,2

図2(実施例1)、図3(実施例2)に、上記層構成を 用いた光記録媒体の反射率と吸収率を示す。符号Rは反 射率、符号Aは吸収率である。とれらの図は多層薄膜 を、一般によく知られているマトリックス法を用いて計 算したものであり、横軸は金属層の厚さを表わしてい る。金属層の材料は、A1-Ti合金(Ti含有量1. Owt%) である。波長はいずれもλ=650nmで計

【0018】ここで用いた光学定数n,k(nは屈折 単膜を2000人厚にガラス基板上にスパッタリング し、得られた各々の単膜サンプルをエリプソメーター (He-Ne: λ=633nm) で測定して求めた。以 下にその値を示す。

Al-Ti薄膜の光学定数n, k

n = 1.05, k = -5.70(1)

Ge薄膜の光学定数 n, k

n = 4.86, k = -1.76 (2)

【0019】図2はGeの膜厚を20nmに固定し、A

のAl-Ti膜厚と、反射率Rおよび吸収率Aとの関係 を表わしたものである。反射率Rと吸収率Aは反比例の 関係にあり、Al-Ti膜の膜厚を増加させて反射率を 高くすると吸収率Aは減少する。吸収率Aが減少する と、レーザー集光スポット内の膜中の温度上昇が抑えら れるため、感度が低下する。したがって、Al-Ti/ Geの2層構成の場合においては、感度の低下を抑える ため吸収率Aを30%以上に確保し、かつ高反射率 (R >45%) にするには、Al-Ti膜の膜厚dlをdl 10 ≦15 n m とするのが望ましい。

【0020】図3はGeの膜厚を60nmに固定し、A 1-Ti膜の膜厚を0から20nmまで変化させたとき のAl-Ti膜厚と、反射率Rおよび吸収率Aとの関係 を表わしたものである。図2と図3を比較して明らかな ようにGeの膜厚を厚くすると、A1-Ti膜の厚さが 10nm以下の領域で吸収率Aが大きく増加する。

【0021】実施例3,4

図4 (実施例3)、図5 (実施例4) に、金属層の材料 としてAuを使用した光記録媒体の反射率Rと吸収率A 20 を示す。波長は実施例1, 2と同様にλ=650nmで 計算した。ここで用いたAuの光学定数n,kは、Au の単膜を2000A厚にガラス基板上にスパッタリング し、得られた単膜サンプルをエリプソメーター (He‐ $ne: \lambda = 633nm$) で測定して求めた。以下にその 値を示す。

Au薄膜の光学定数n,k

n = 0.22, k = -3.52 (3)

【0022】図4はGeの膜厚を20nmに固定し、A uの膜厚をOから20nmまで変化させたときのAu膜 30 厚と、反射率Rおよび吸収率Aとの関係を表わしたもの である。図4で明らかなように、高反射率で高い吸収率 (A>30%) を得るためには、Auの膜厚dlをdl ≦20nmとするのがよい。

【0023】図5はGeの膜厚を60nmに固定し、A uの膜厚を0から20nmまで変化させたときのAu膜 厚と、反射率Rおよび吸収率Aとの関係を表わしたもの である。図4との比較で明らかなように、Geの膜厚を 厚くすると吸収率Aが大きく増加する。

【0024】実施例5

率、kは消衰係数)は、AI-TiおよびGeの各々の 40 図6は図2、図3の実施例に係る光記録媒体(PC基板 上にAl-Ti合金膜およびGe膜を形成)において、 Al-Tiの膜厚を10nmに固定するとともに、Ge の膜厚を0から100nmまで変化させた場合のGeの 膜厚と、反射率Rおよび吸収率Aとの関係を示したもの

【0025】図6で明らかなように、Geの膜厚が10 nmから35nmの膜厚領域においては、反射率Rは3 0%から67%程度までGeの膜厚が増加するに従って 増加する。逆に吸収率Aは50%から30%程度まで減 1−Ti膜の膜厚を0から20nmまで変化させたとき 50 少する。Geの膜厚が35nmから70nmの領域で

は、反射率Rは67%から55%まで下り、逆に吸収率 Aは30%から40%程度まで増加する。Geの膜厚が 70nm以上では反射率Rと吸収率Aは共に、定常値 (Rは約60%、Aは約40%) に近づく。Ge膜厚を 薄くして高感度光記録媒体を得る場合には、Ge膜厚d 2を;d2≦35nmに設定するのがよい。また、感度 に余裕がある場合は、Geの膜厚をd2≦70nmに設 定しても問題がない。

【0026】実施例6

図7はPC基板上に形成したAuとGeとの層構成の反 10 射率Rと吸収率Aを、Geの膜厚を0から100nmま で変化させて計算したものである。この場合、Auの膜 厚は10nmに固定した。図7から明らかなように、G eの膜厚が10nmから35nmまで増加すると、反射 率Rは15%から60%程度まで増加し、吸収率Aは5 5%から33%程度まで逆に減少する。Geの膜厚が3 5 n mから70 n m になると反射率 R は60% から40 %に減少し、吸収率Aは33%から58%まで逆に増加 する。

【0027】Ge膜厚が70nm以上では、反射率Rと 20 ためROM互換が可能となる。 吸収率Aは共に、定常値(Rは約47%、Aは約54 %) に近づく。したがって、Au膜の場合にも図6の実 施例と同様に、高感度化するにはGe膜厚d2を、d2 ≤35nmに設定するとよい。また、感度に余裕がある 場合は、d2≦70nmに設定しても何ら問題ない。

【0028】なお、上記したAu膜を用いた実施例(図 4、図5、図7)においてAuの他に、Auを主成分と した合金、Ag、CuあるいはAg, Cuを主成分とし た合金についても、光学定数n、kがAuの値に近いの で、同様の結果となる。また、A1-Ti膜を用いた実 30 ラフである。 施例(図2、図3、図6)においてA1-Ti膜の他 に、AIあるいはAIを主成分とした他の合金について も、光学定数n、kがAl-Ti(Ti含有量1.0w t%)の値に近いので、同様の結果となる。

【0029】実施例7

次に、本発明の光記録媒体および、これによる記録・再 生の実施例について述べる。トラッキング用の溝を設け たポリカーボネート基板上に厚さ12nmのAl-Ti 層、厚さ20nmのGe層を順次スパッタリング法によ り成膜後、Ge層表面に紫外線硬化樹脂をスピンコート 40 した(光硬化性樹脂による保護膜の形成)。

【0030】作製した光ディスクを線速3.5m/sで 回転し、トラック上20MHzの信号を記録した。との ときの光学系は入=650nm、対物レンズNA=0.

6、レーザーパワーは7mWに設定した。信号を記録し た光ディスクの再生信号から、未記録部の反射率46 %、記録マークの反射率は18%となり、モジュレーシ ョンの値として約60%が得られた。これらの実施結果 から、作製した光記録媒体は、記録マークの反射率が未 記録部の反射率よりも低い、いわゆるHighto L owの再生信号特性をもつことが確認された。

[0031]

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、請求項1 に記載の発明では、基板上に金属又は半金属、あるいは これらの合金からなる第1層と、GeまたはGe合金か らなる第2層とで記録層を形成したので、記録層の層数 が少なく、低価格化が容易であり、かつ高反射・高感度 の追記型光記録媒体を提供することができる。

【0032】請求項2に記載の発明では、基板上に第1 層と、その上に第2層とを設けて記録層を形成するとと もに、未記録部の反射率を記録マーク部の反射率よりも 高くしたので、基板側から記録・再生を行うことでHi gh to Lowの記録を実現することができ、この

【0033】請求項3,4,5に記載の発明によれば、 請求項1,2の発明よりも更に顕著な効果を奏する光記 録媒体を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係る光記録媒体の構造を 示す断面図である。

【図2】実施例1に係る光記録媒体の光学特性を示すグ ラフである。

【図3】実施例2に係る光記録媒体の光学特性を示すグ

【図4】実施例3に係る光記録媒体の光学特性を示すグ ラフである。

【図5】実施例4に係る光記録媒体の光学特性を示すグ ラフである。

【図6】実施例5に係る光記録媒体の光学特性を示すグ ラフである。

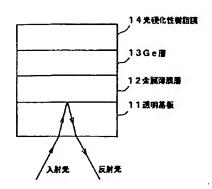
【図7】実施例6に係る光記録媒体の光学特性を示すグ ラフである。

【符号の説明】

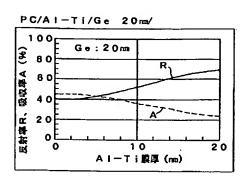
- 11 透明基板
- 12 金属薄膜層
- 13 Ge層
- 14 光硬化性樹脂膜

【図1】

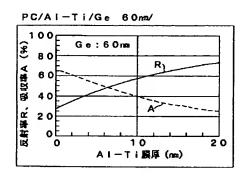
斗



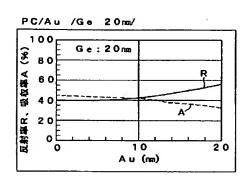
【図2】



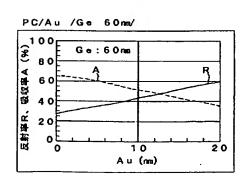
【図3】



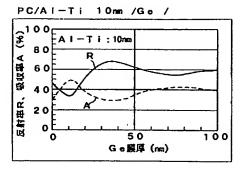
【図4】



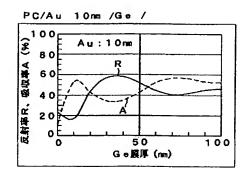
【図5】



【図6】



【図7】



フロントページの続き

(72)発明者 影山 喜之 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内 (72)発明者 小名木 伸晃 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式 会社リコー内 F ターム(参考) 2H111 EA03 EA21 EA43 FA02 FA14 FB05 FB17 FB21 5D029 HA04 JA01 JB03 JB05 JB17 JB35 JC02